

走査型電子顕微鏡講習会

平成29年度より、エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）の分析計測機器・半導体デバイス関連機器を対象とする共用システムがスタートしました。今回も、本学の特命技術職員が、走査型電子顕微鏡の取扱い方法等に関する講習会を開催します。【低真空モードで観察】

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

要予約

日時 平成30年10月23日（火） 14:40～

場所 エレクトロニクス先端融合研究所 2階
共同研究室 5

講師 渡邊 一平（特命技術職員）

機器 日立ハイテクノロジーズ
走査型電子顕微鏡（S-3000N）

観察試料募集

試料には制限等がございます、
事前にご相談を
お願いいたします。

表面・形状観察【低真空モード:非導電性試料を前処理無しで観察及び分析可能】

- ・測定原理：電子銃：熱電子放出型電子銃
（Wヘアピン型電子銃）
- ・分解能：3.5nm（高真空，二次電子像，加速電圧25kV）
5.0nm（低真空，反射電子像）
- ・倍率：15～300,000倍
- ・加速電圧：0.3～30kV



走査型電子顕微鏡 S-3000N

申込み EIIRIS共用システム（担当：渡邊、溝端）

内線：3046 **e-mail**：techsupport@rac.tut.ac.jp

WEBサイト：<http://rac.tut.ac.jp/sentan/>

このセミナーは、文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導入支援プログラム）」の一環として開催します。